## TELANZEIGE

)	AUFSATZ-REDAKTION	NOTIZEN	442	Werkstoffkenngrößen mit	
	DrIng. Dietmar Aurich, Ltd. Dir. u. Prof. (verantwortlich)	VERANSTALTUNGEN	444	digitaler Bildverarbeitung ermitte (Eva Kieselstein, Bettina Seiler, Michael Dost, Bernd Michael)	eln 471
	Dr. Manfred P. Hentschel Dr. Gerd-Rüdiger Tillack BAM, Unter den Eichen 87 D-12205 Berlin Tel. 030/8104-1509 Fax 030/8104-1107	FACHAUFSÄTZE  Miniflachzugproben prüfen - Richtige Probenentnahme und zuverlässige Prüfverfahren - (Djordje Dobi, Eva Junghans)	445	Analysensiebe kalibrieren – Ergebnisse eines Ringversuchs für die Charakterisierung eines Kontrollmaterials – (Wilfried Hinrichs)	474
	REDAKTION MÜNCHEN DiplIng. Angelika Espinosa Tel. 089/99830-615 Fax 089/99830-623 E-Mail: espinosa@hanser.de	Werkstoff-Ratcheting berechnen – Qualitativer Vergleich von nicht linear-kinematischen Modellen – (Benedikt Postberg, Eckart Weiß)  Spanwurzelentstehung bei hohen Geschwindigkeiten	451	Personen zertifizieren – Ein zunehmender Trend und seine Auswirkungen – (Günter Heinke, Klaus Jäger)	482
	ANZEIGEN	- Spanwurzelentstehung mit Split-Hopkinson-Bar-Methode		KURZBERICHT	
	Rolf Hörr Tel. 089/99830-215 Fax 089/99830-623	simulieren – (Essam El-Magd,	457	Mehr Qualität	487
1	ABO/VERTRIEB Werner Hartmann	Christoph Treppmann)  Verhindern von Korrosion bei Klebverbindungen	437	NEUE PRODUKTE	489
1	Tel. 089/99830-102 Fax 089/984809	(Joachim Bischoff, Otto-Diedrich Hennemann)	461	INSERENTENVERZEICHNIS	490
	VERLAG Carl Hanser Verlag Kolbergerstraße 22 D-81679 München	Glasmatrix-Verbundwerkstoffe zerstörungsfrei prüfen – Die Beziehung zwischen innere Reibung und Mikrorißenstehung		VORSCHAU/IMPRESSUM	492
d n	E-Mail: info@hanser.de	(Aldo R. Boccaccini, Thorsten Tonnesen)	466	BEZUGSQUELLEN	493

LEO Elektronenmikroskope sind bekannt für innovative Elektronenoptik, höchste Flexibilität für verschiedenste Abbildungs- und Analyse-

techniken, sowie einfachste Bedienung. Das LEO 922 OMEGA ist ein 200 kV Energiefilter-Transmissionselektronenmikroskop. Es bletet, neben hoher Leistung für Abbildung und Beugung, höchste Vielseitigkeit durch komplette Systemintegration von EELS, ESI und EDX. Es erfüllt in hervorragender Weise alle Erfordernisse für Materialuntersuchungen an dünnen Präparaten wie z.B. die Nanoanalyse von Halbleitern, Keramiken oder Polymeren. Das Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop LEO 1550 mit GEMINI Optik ist ebenfalls für die Nanoanalyse konzipiert. Gleichzeiter Anbau von EDX und WDX Detektoren an eine große Probenkammer, in Verbindung mit einem kurzen Arbeitsabstand, garantieren höchste Flexibilität für Werkstoffanalysen, sowie höchste Auflösung, selbst bei niedrigsten Beschleunigungsspannungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich

LEO Elektronenmikroskopie GmbH Carl-Zeiss-Str. 56 D-73447 Oberkochen Tel.: 073 64/94 61 37 Fax: 073 64/94 48 51 E-mail: info@leo.de

